住友重機械工業㈱製　512ch　γ線検出モジュール　一式	55	55
マイクロ・ナノマシニング研究教育センター棟クリーンルーム修繕業務　一式	99	99
(独)Atomica社製　表面分析装置　ＳＩＭＳ4000　修繕業務　一式	94	94
(仏)シグマフィ社製　複合機能型四極電磁石　一式	78	78
(独)ハイデルベルグインスツルメンツマイクロテクニック社製　レーザー直接描画装置　ＤＷＬ2000ＳＤ　一式	84	84
電子科学㈱製　昇温脱離ガス分析装置　ＴＤＳ1200Ｓ／Ｗ　一式	44	44
日本電子㈱製　電界放出形透過電子顕微鏡　ＪＥＭ―2100Ｆ　一式	110	110
㈱リガク製　試料水平型多目的Ｘ線解析装置SmartLab９ＰＷＡ　一式　外１点	50	50
エア・ウォーター㈱製　超高真空ＣＶＤ装置　ＶＣＥ―Ｓ2103ＴＨ　一式	82	82
㈱旭商会仙台店製　ナノバイオ自動成膜装置　ＩＢＫ―311Ｓ　一式	47	47
㈱睦コーポレーション製　テラヘルツ・パルス分光計測装置　THz―TDS2000ms修繕業務　一式	36	36
(英)ＳＰＴＳ社製　タングステンバリア金属膜成膜装置　Sigma―WfxP300ＡＨＦ　一式	109	109
ＳＰＰテクノロジーズ㈱製　ＩＣＰプラズマエッチング装置　ＭＵＣ21　ＳＲ　一式	65	65
卓上フード付き中央実験室　一台	39	39
(米)エービー・サイエックス社製　質量分析装置　ＡＰＩ5000　１式　外８点　移設業務　一式	35	35
㈱ユーテック製　シリコン酸化被膜形成用０３・ＴＥＯＳ／ＣＶＤ装置　一式	49	49
キヤノン㈱製　縮小投影露光装置　ＦＰＡ―5500iZa　一式	200	200
日本電子㈱製　超伝導核磁気共鳴装置　ＪＮＭ―ＥＣＡ600ＦＴＮＭＲ装置　一式	105	105
三浦工業㈱製　高圧蒸気滅菌装置　Ｓ―120ＦＷ（蒸気ボイラ含む）　一式	52	52
(蘭)ＦＥＩ社製　超高分解能収差補正型走査透過電子顕微鏡システム　Titan　G260―300型一式	425	425
(米)National Electrostatics社製　１ＭＶペレトロンタンデム加速器システム　３ＳＤＨ―２　一式	115	115
㈱アルバック製　ドライエッチング装置ＮＥ―550　一式　外５点	617	617
(オーストリア)EV Group社製　ボンドアライナー　一式　外２点	260	260
三菱重工業㈱製　実荷重多点載荷システム修繕業務　一式	92	92
粒子配列制御システム　一式	52	52
三菱重工業㈱製　自己組織化チップ貼り合せ装置修繕業務　一式	52	52
㈱ダルトン製　ＳＰＦ試験室システム　一式	204	204
(独)シーメンス社製　バイプレーン心臓血管撮影装置　Artis zee BC　一式　外２点	299	299
(米)ＧＥ社製　核医学画像診断装置（ＳＰＥＣＴ―ＣＴ）Infinia３Hawkeye４　一式	57	57
㈱日立メディコ製　ＩＨＥ―Ｊ対応型放射線部門システム　OPEN―PACS Series　画像管理システム　We View　一式　外２点	288	288

附　属　明　細　書

(1)　固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第84　特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第89　資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)並びに減損損失の明細

（単位：千円）

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額			差引当期末残高	摘要
							当期償却額		当期損益内	当期損益外		
	建物	102,148,188	10,263,896	522,399	111,889,684	40,523,646	4,575,083	842,828	—	839,411	70,523,209	
	構築物	7,911,673	1,686,356	63,682	9,534,346	4,805,284	358,027	20,943	—	11,644	4,708,118	
	機械装置	474,414	—	2,987	471,426	276,023	30,147	—	—	—	195,402	